

# ねじれ振り子型重力波望遠鏡

## TOBAの開発(38):

### 低温モノリシック干渉計の開発と観測

---

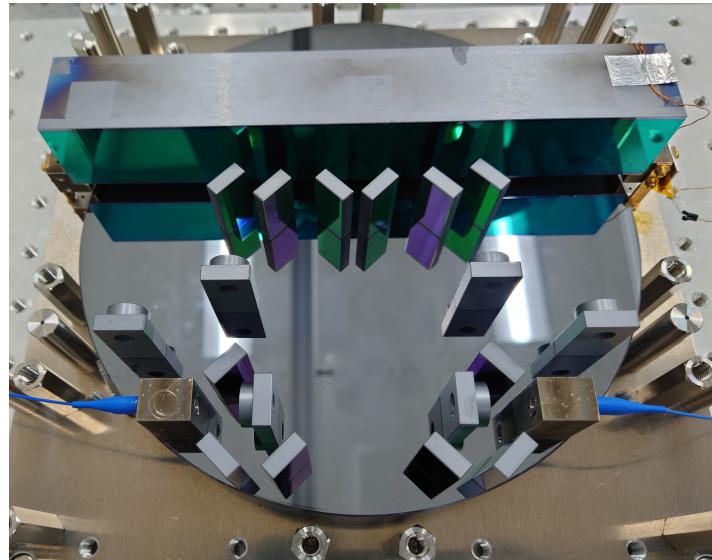
高野 哲, 大島 由佳, Ooi Ching Pin, Choi Minseo, Cao Mengdi<sup>A</sup>,

道村 唯太<sup>B,C</sup>, 小森健太郎<sup>C</sup>, 安東 正樹

東大理, 北京師範大天文<sup>A</sup>, カリフォルニア工科大学<sup>B</sup>, 東大ビッグバン<sup>C</sup>

# 概要

- ・ねじれ振り子型重力波望遠鏡 TOBA を用いた0.1 Hz帯の重力波の検出を目指している
- ・Phase-IIIと呼ばれる低温ねじれ振り子のプロトタイプを開発中
- ・高感度化に向けて、モノリシック読み取り光学系の開発
  - モノリシック光学系の構築を一部完了
  - 干渉計のアライメントを行っている



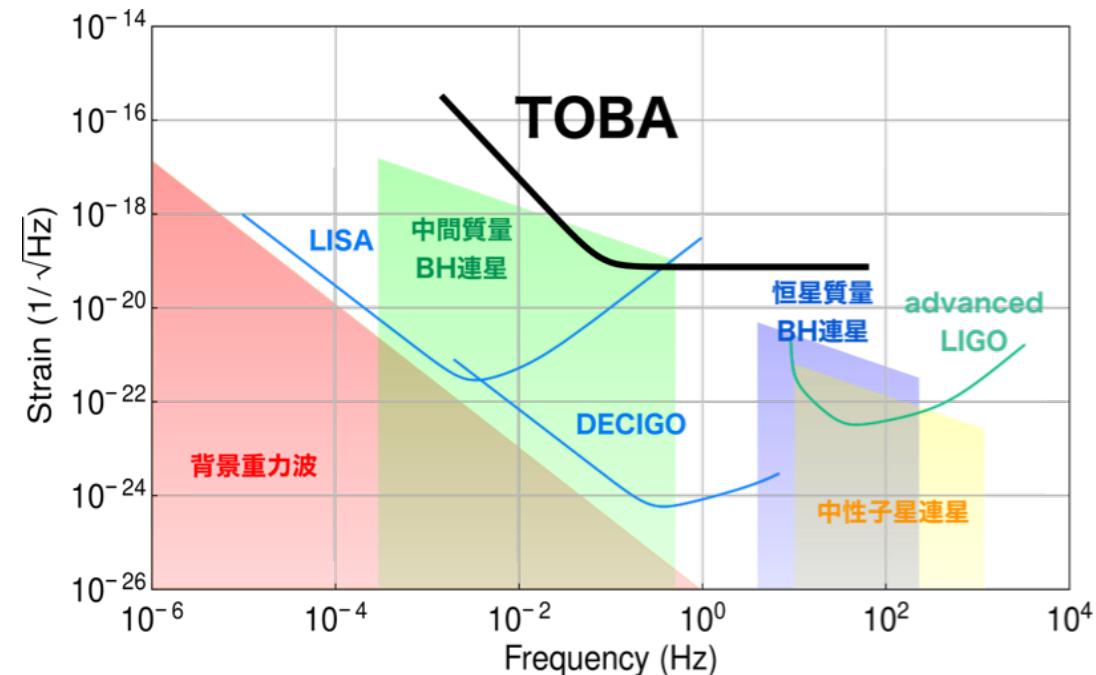
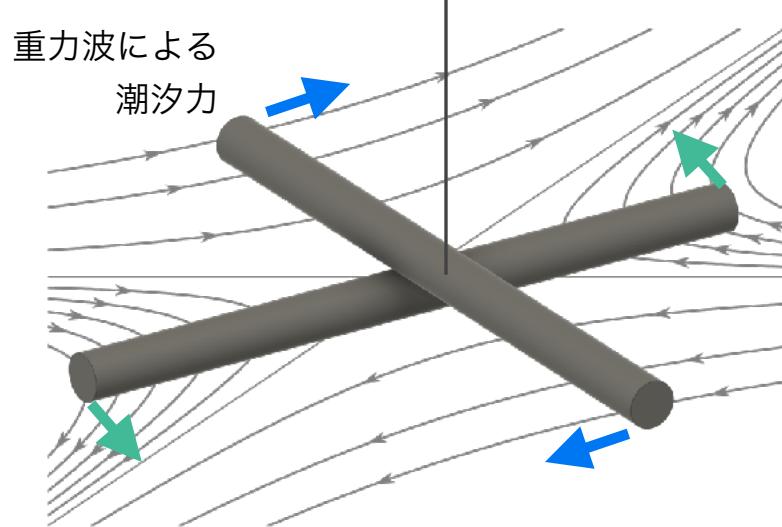
# Contents

- TOBAについて
- TOBAの読み取りモノリシック光学系
- モノリシック光学系の構築
  - ▶ 光学系デザイン
  - ▶ 光学素子
  - ▶ アラインメント
- まとめ, 今後の展望

# ねじれ振り子型重力波望遠鏡TOBA

## ねじれ振り子型重力波望遠鏡TOBA (TOrsion Bar Antenna)

- 水平に懸架した棒状マスのねじれ回転を検出
- 共振周波数~数mHz → **0.1-10 Hz**の低周波重力波の観測
- 地上で観測可能(宇宙に打ち上げる必要がない) → 低コスト
- 目標: 10mスケールで  **$h \sim 10^{-19} / \sqrt{\text{Hz}} @ 0.1 \text{ Hz}$**



# 研究計画



## 現在: Phase-III TOBAの開発

- 低温ねじれ振り子の実証
- 障害となる雑音源の特定と低減

# Phase-III TOBAの構成

## 低温懸架系

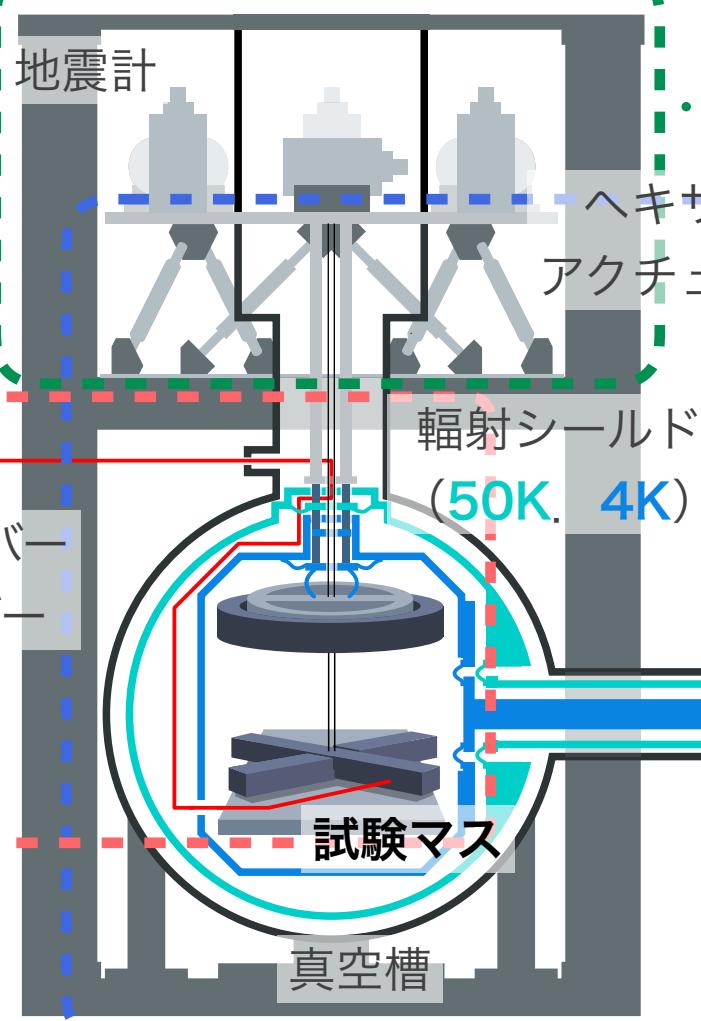
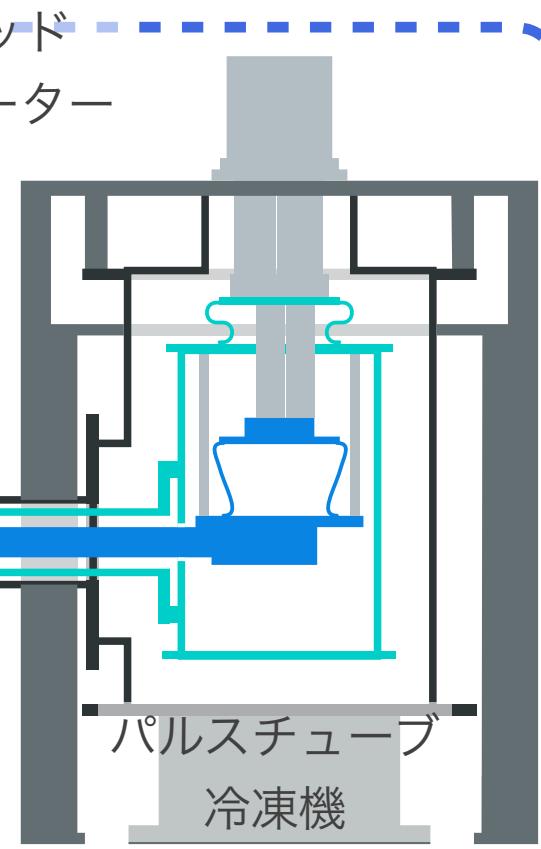
- ・2段ねじれ振り子
- ・35 cm 試験マスx2
- ・50 Kと4 Kの2つの輻射シールド

## 読み取り光学系

- レーザー干渉計による角度読み取り
- モノリシック光学系

## 能動防振系

- ・地震計とアクチュエータによるフィードバック制御系
- ・角度変動を読む傾斜計



# 変位読み取り雑音の低減

モノリシック光学系

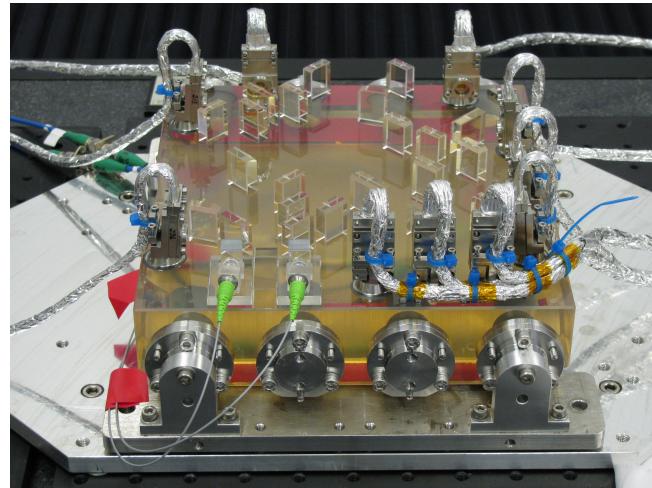
: 光学基板に光学素子を**直接貼り付ける**

- ・ 同相雑音除去が効きやすい
- ・ 長時間ドリフトが小さい
- ・ 取り付け後の調整は不可能

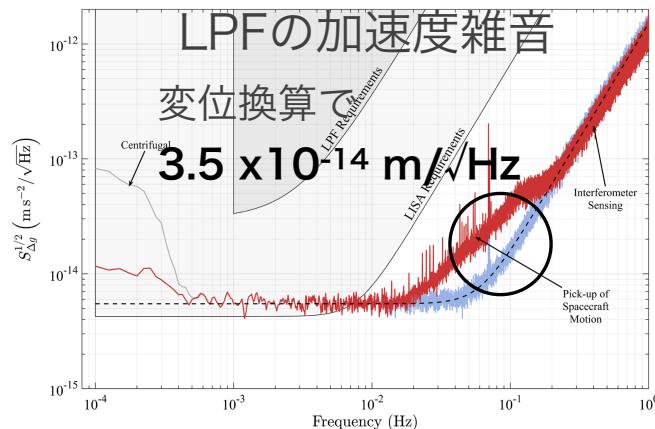
LISA Pathfinderでは  
 $3.5 \times 10^{-14} \text{ m}/\sqrt{\text{Hz}}$  @ 0.1 Hz を達成

低温下でのモノリシック光学系の実現

- ・ 溶融石英は低温での性質が悪い  
(Q値, 熱膨張率)
  - ▶ シリコン基材 + シリコン光学素子で構築
- ・ 目標感度  $10^{-15} / \sqrt{\text{Hz}}$  ( $3 \times 10^{-16} \text{ m}/\sqrt{\text{Hz}}$ ) を目指す



[LISA Mission Proposal](#)



[PRL 116, 231101 \(2016\)](#)

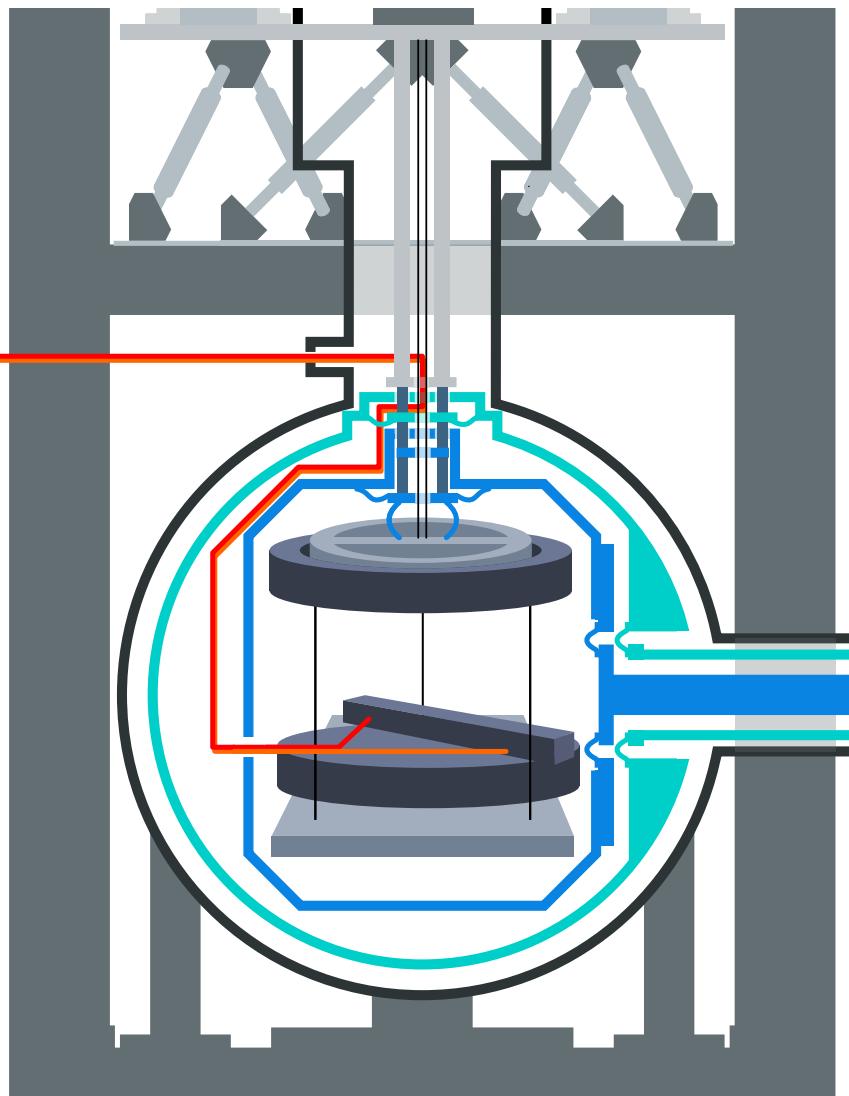
# 変位読み取り雑音

試験マスの読み取り系における雑音

- 原理雑音
  - 散射雑音 → Fabry-Perot 干渉計
  - 鏡の熱雑音（コーティング・基材） → 低温化
- 光学系
  - **光学系の変動**（地面振動・温度変動） → モノリシック干渉計で低減可能
- 信号系
  - 回路の雑音

読み取り雑音が**原理雑音**で制限される干渉計を目指す

# 実験系概要



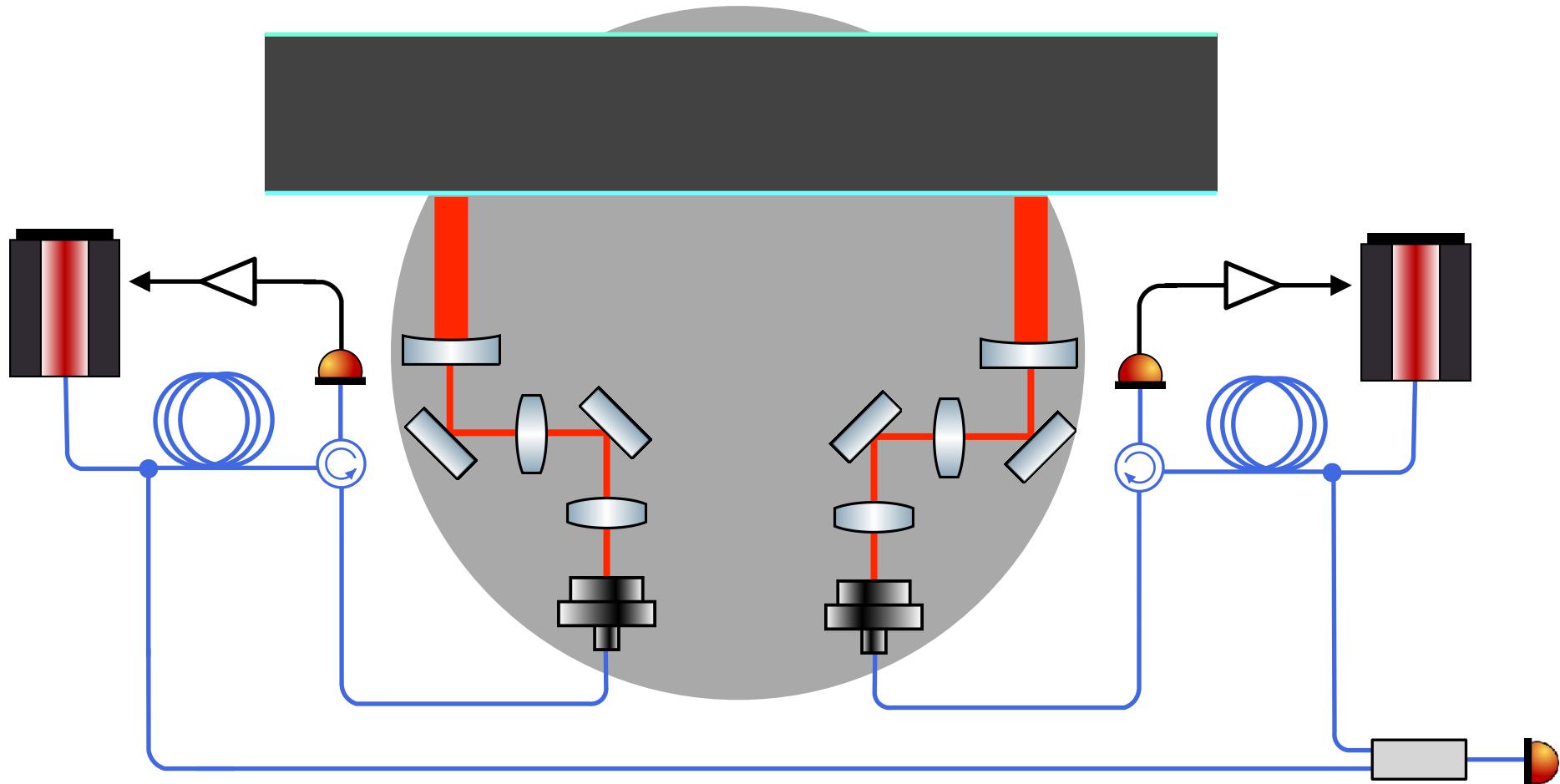
## 構成の簡略化

- 試験マスは懸架せず、  
**光学ベンチ上に1つ固定**
- 光学ベンチは2段振り子
- レーザーは光ファイバー  
を用いて導入

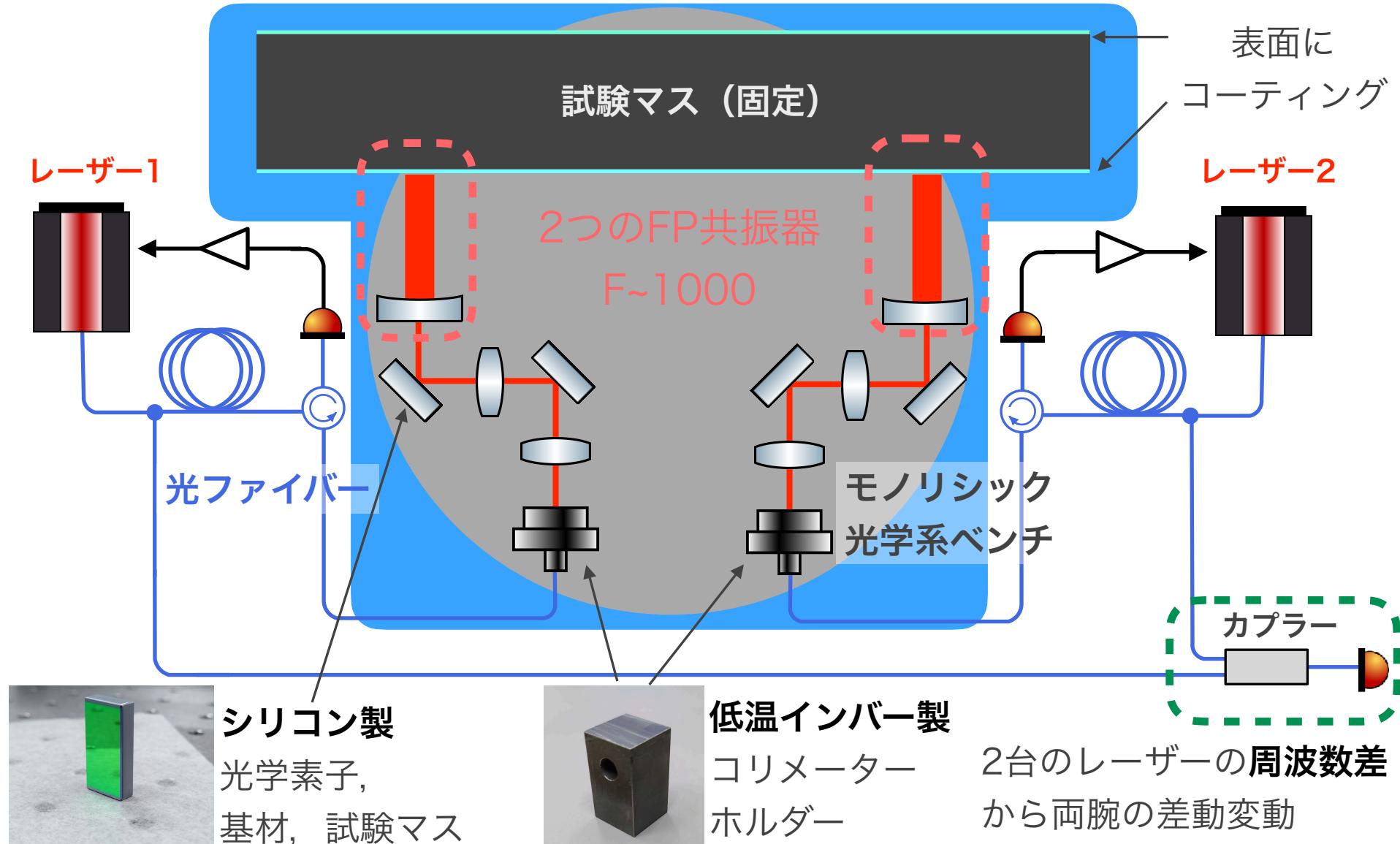
## 目的

- **低温下での運転の実現**
- 変位雑音評価
- 能動防振系を用いて  
**同相雑音除去比の評価**

# 光学系デザイン



# 光学系デザイン



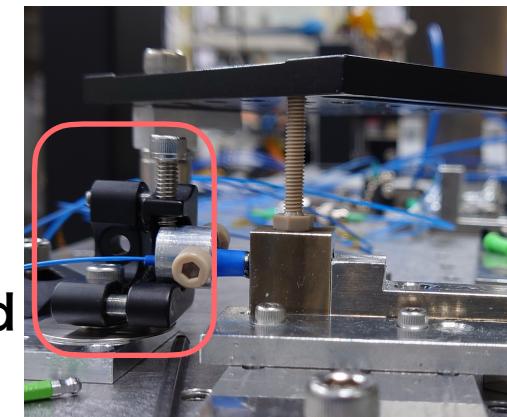
# 光学素子

- 円形素子（レンズ、入射鏡）ジグを使ってホルダーに接着

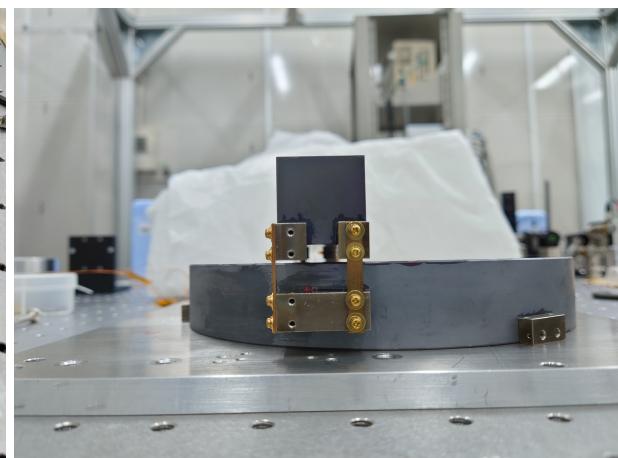
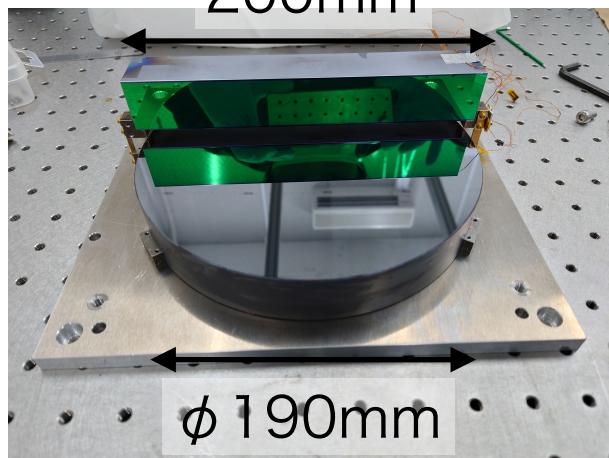


- コリメーター  
偏光とアラインメントを確認して  
ホルダーに接着

ミラー ホルダー  
を動かして調整  
→ ずれは < 2 mrad



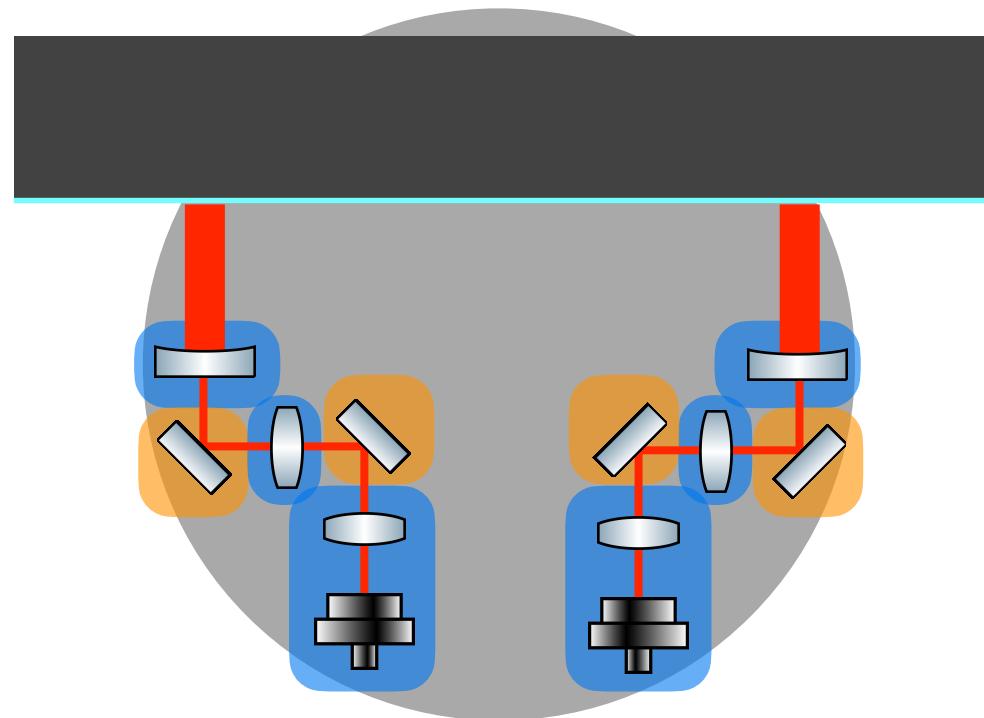
- 試験マス  
板状のヒンジで  
シリコン基板に固定



# アラインメント手法

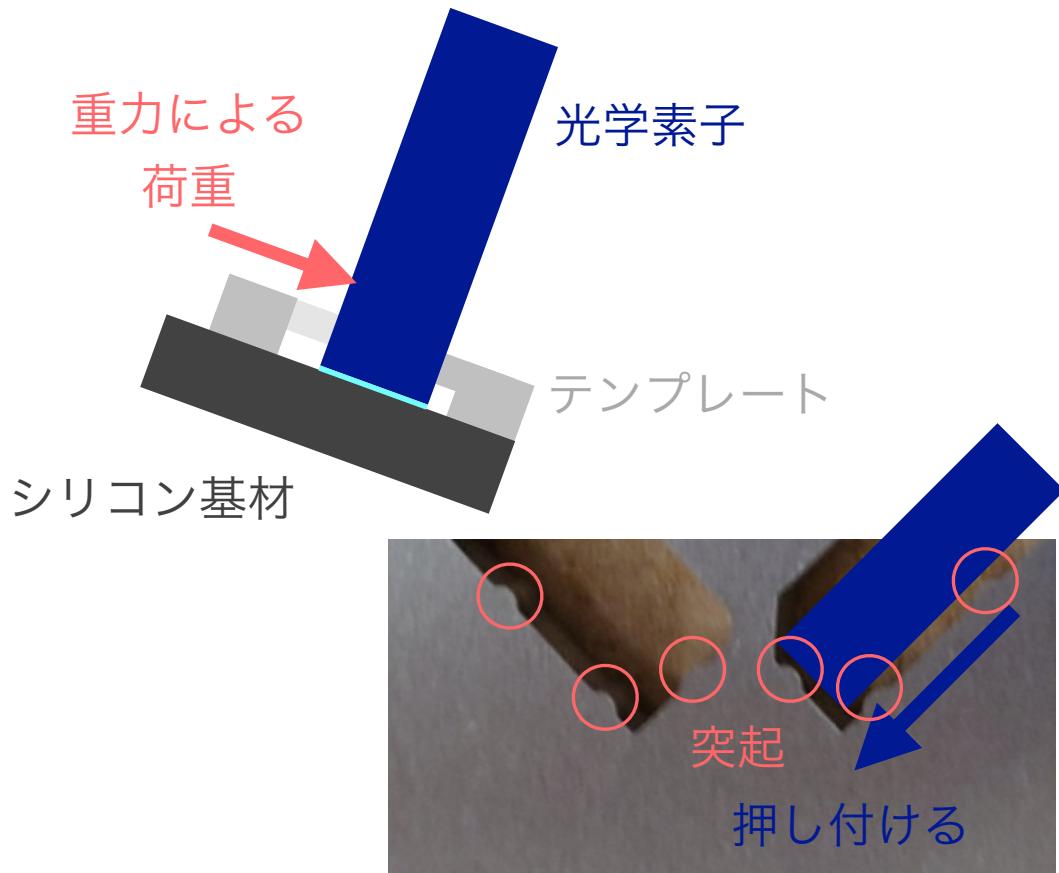
要求精度の異なる2パターンの光学系

- 取り回し, ピックオフ,  
モードマッチング, 入射鏡
  - 精度低め (~1 mrad)
    - ▶ テンプレートを用いて  
アラインメント
- ステアリング鏡
  - 精度高め (~10  $\mu$ rad)
    - ▶ 共振状態を確認しつつ,  
**専用のステージ**で微調整



# テンプレートを用いたアラインメント

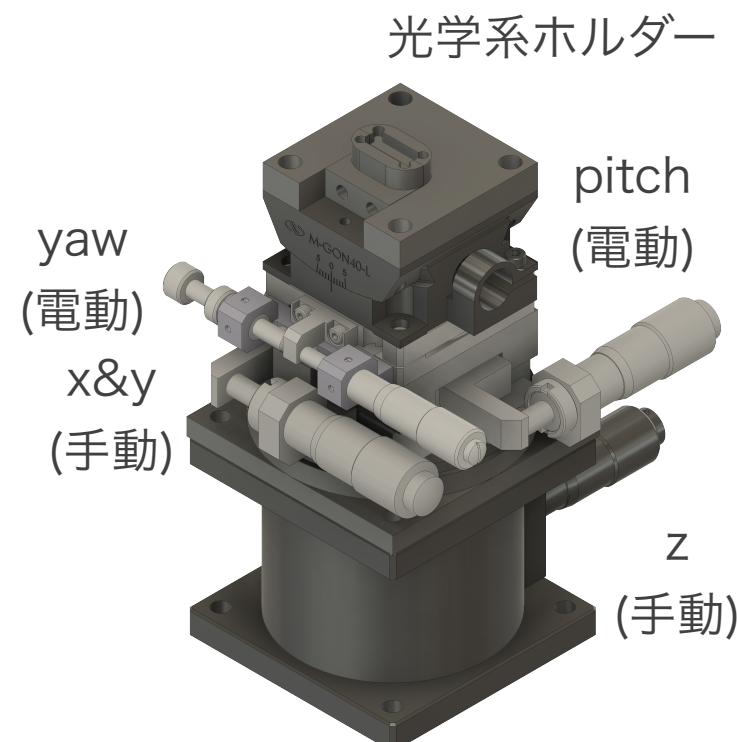
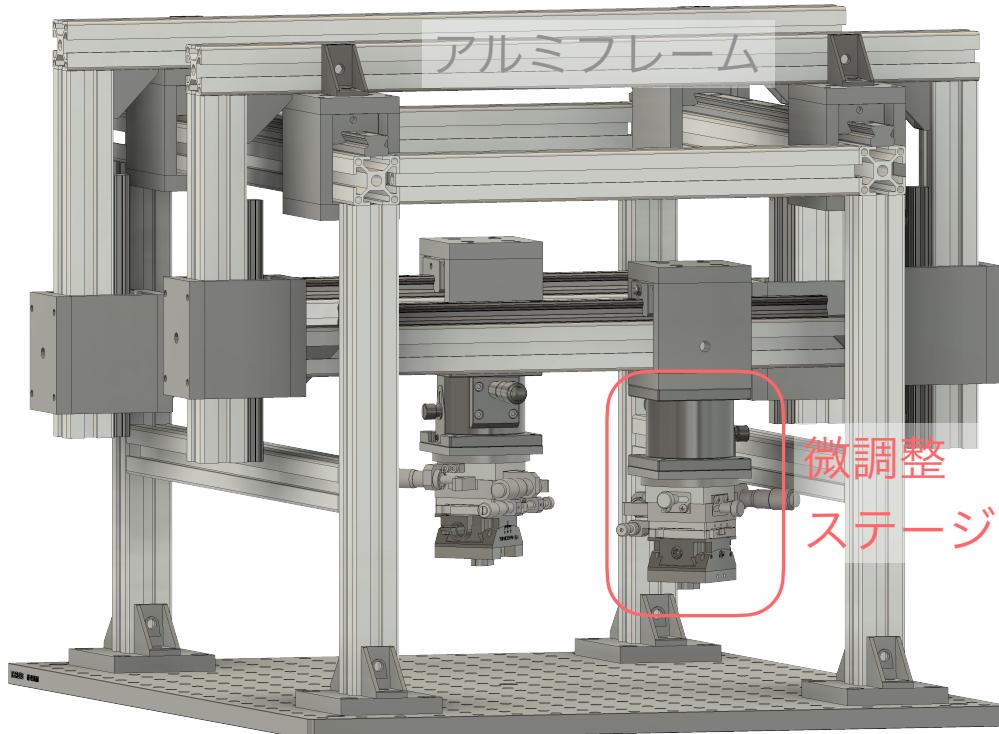
- 突起のついた板に、光学素子を押し付けるような形で固定
- 全体を傾けることで荷重をかける



# ステージを用いた微調整

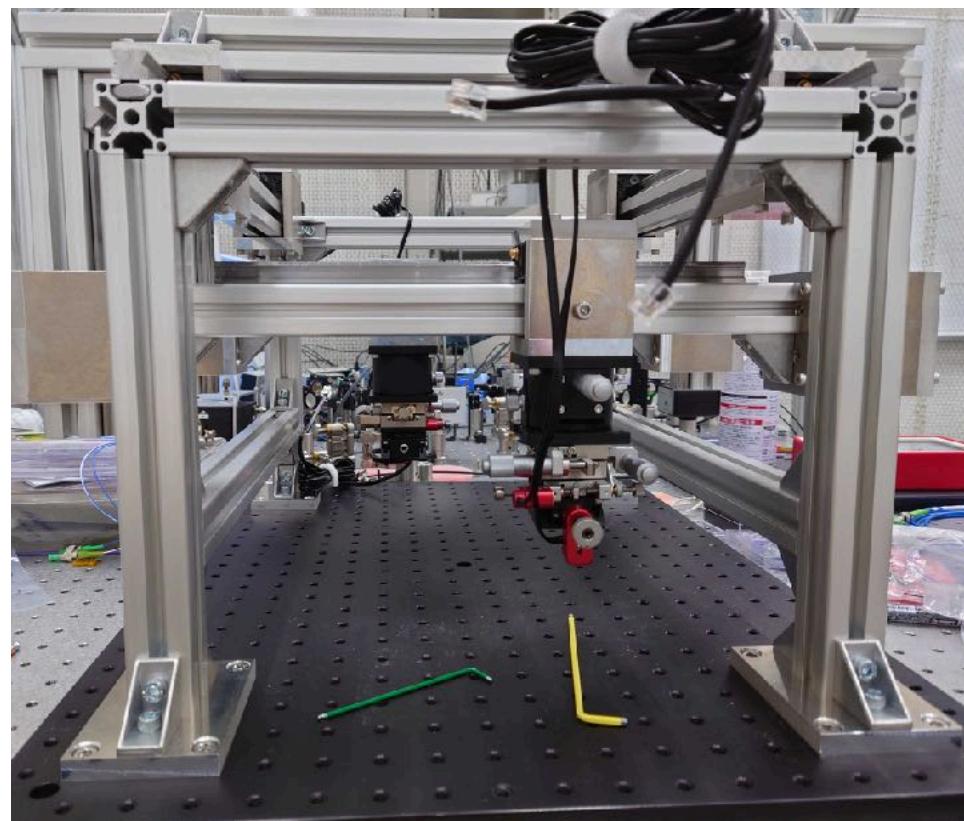
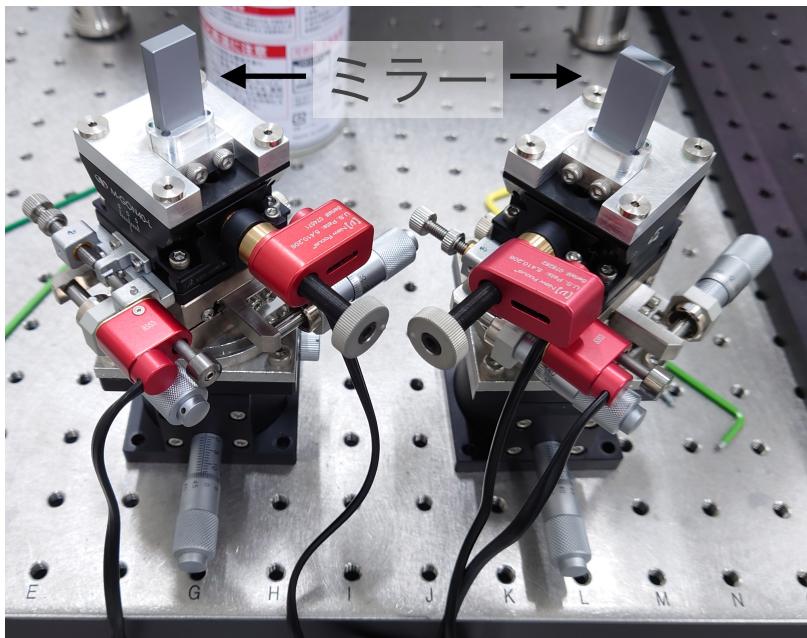
5自由度 (x, y, z, pitch, yaw) に移動可能なステージ x2

- リニアガイドで粗調 (x, y, z)
- 手動ステージで微調 (x, y, z)
- 電動ステージで微調 (pitch, yaw)



# 微調整ステージ

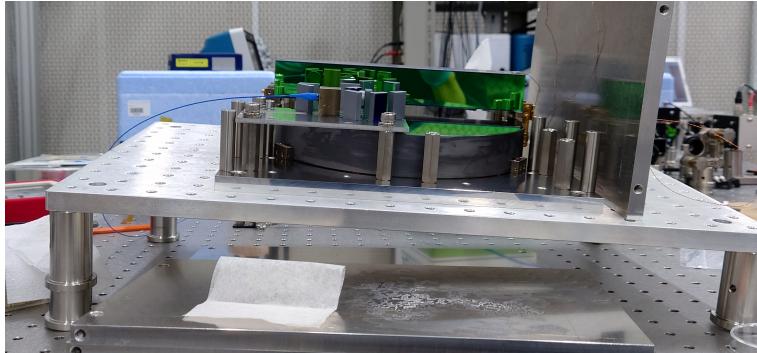
## 微調ステージ



ステージ全体

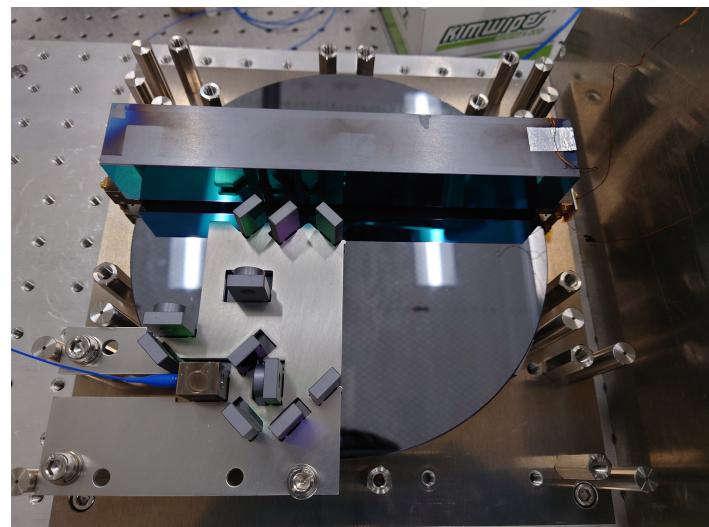
# 入射光学系の接着

入射光学系の一部をテンプレートで接着

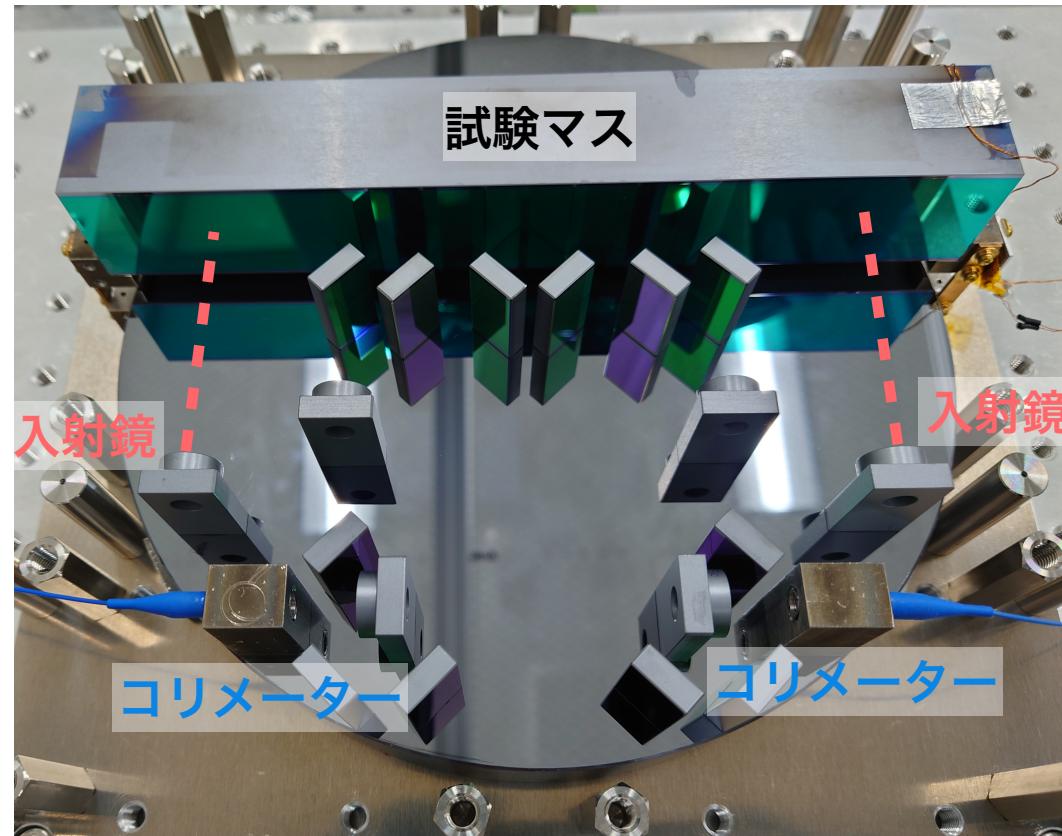


↑傾けて重力による荷重をかける

↓テンプレートで位置決め

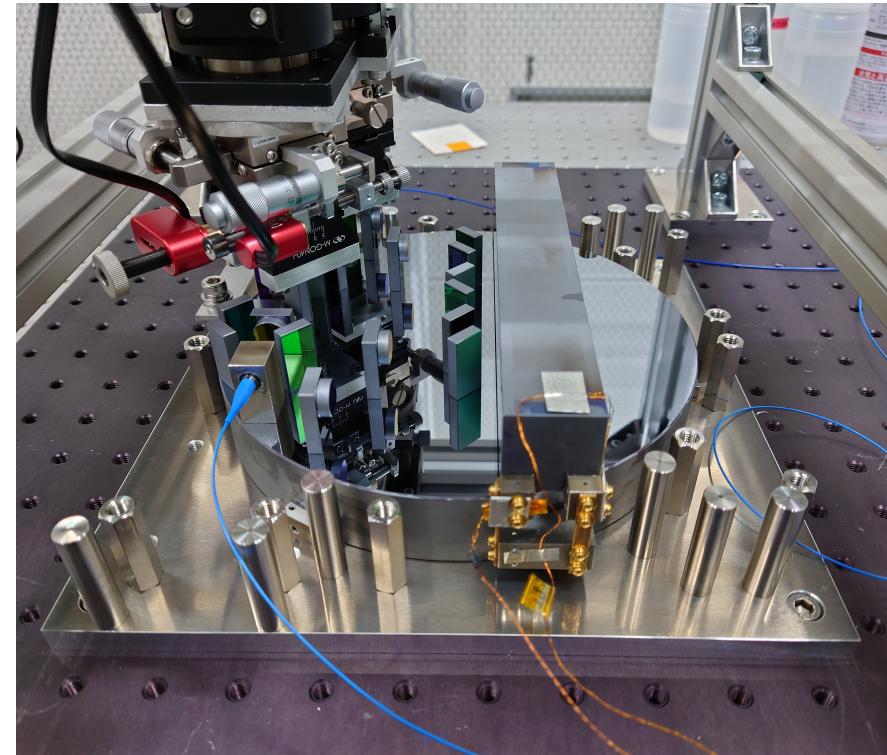
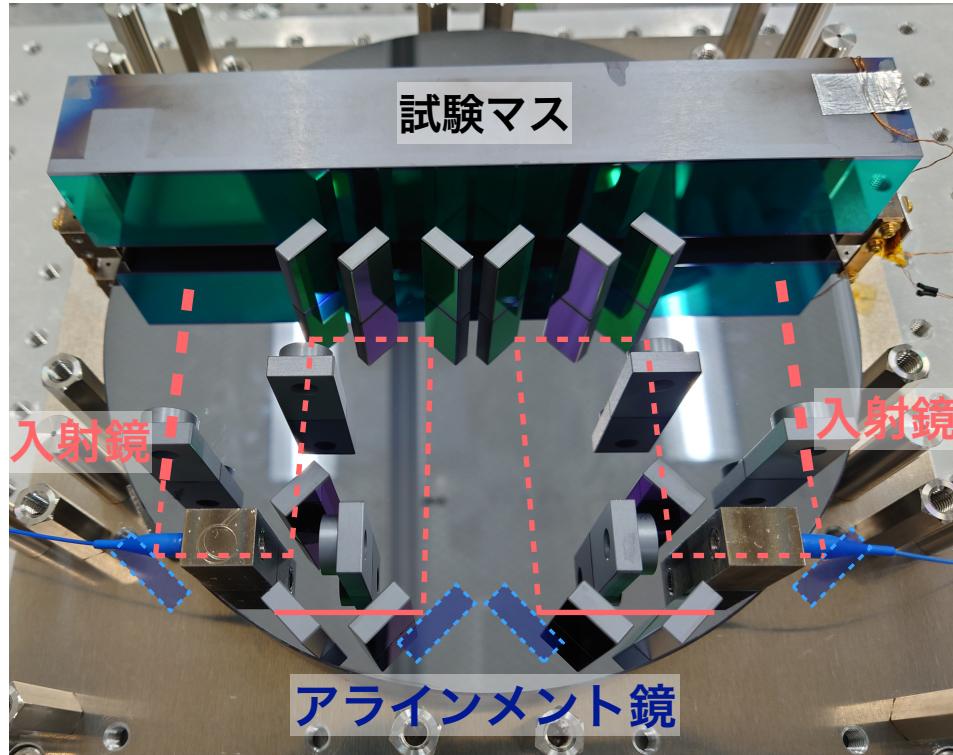


↓入射光学系を接着



# 入射光学系のアライメント

微調整ステージを用いて入射光のアライメントを合わせる

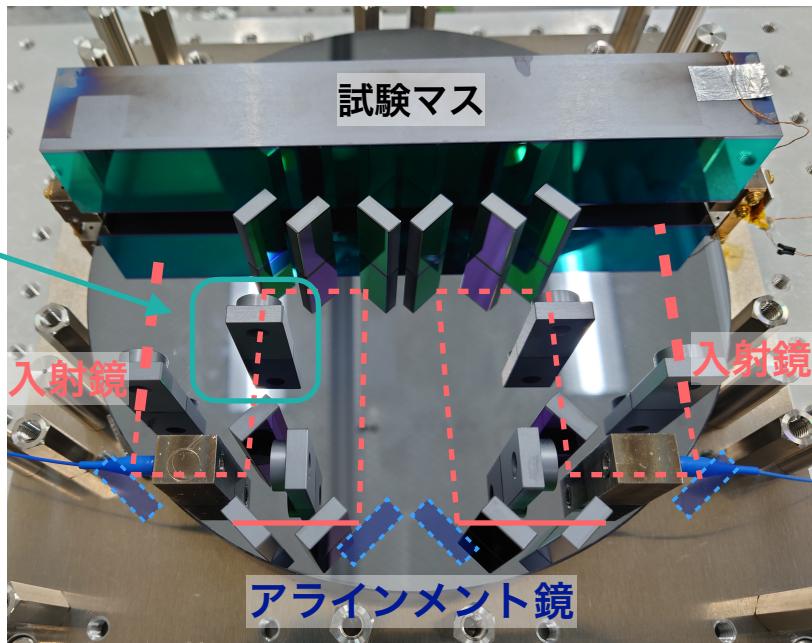
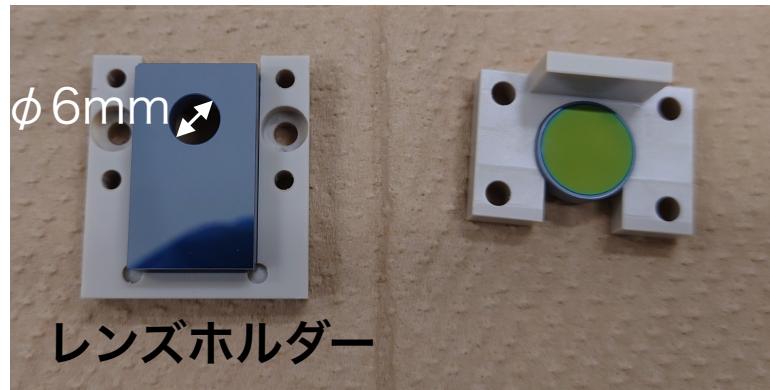


- ▶ 途中でビームがクリップして完全には合わせられていない  
(モードマッチ率 60%程度が限界)

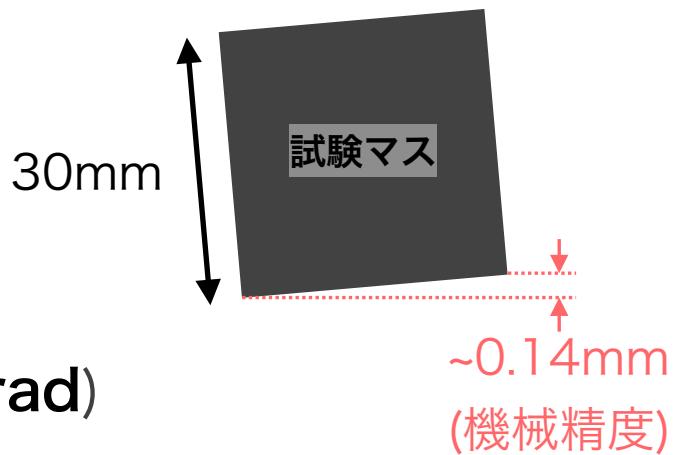
# ビームのクリップ

アラインメントを合わせようとする  
レンズホルダーで**pitch方向**にクリップ

- ここでクリップ
- レンズホルダーの口径 6 mm
  - ▶ クリップしない範囲で調整できる  
入射光軸の角度は **4.5 mrad**



- 試験マスの固定の際のずれによっては  
この範囲を越えうる ( $0.14/30 \sim 4.7 \text{ mrad}$ )



# 共振器のビーム光軸

裏側（試験マス側）から光を入射する

- ▶ 共振器軸をビームスポット高さから評価

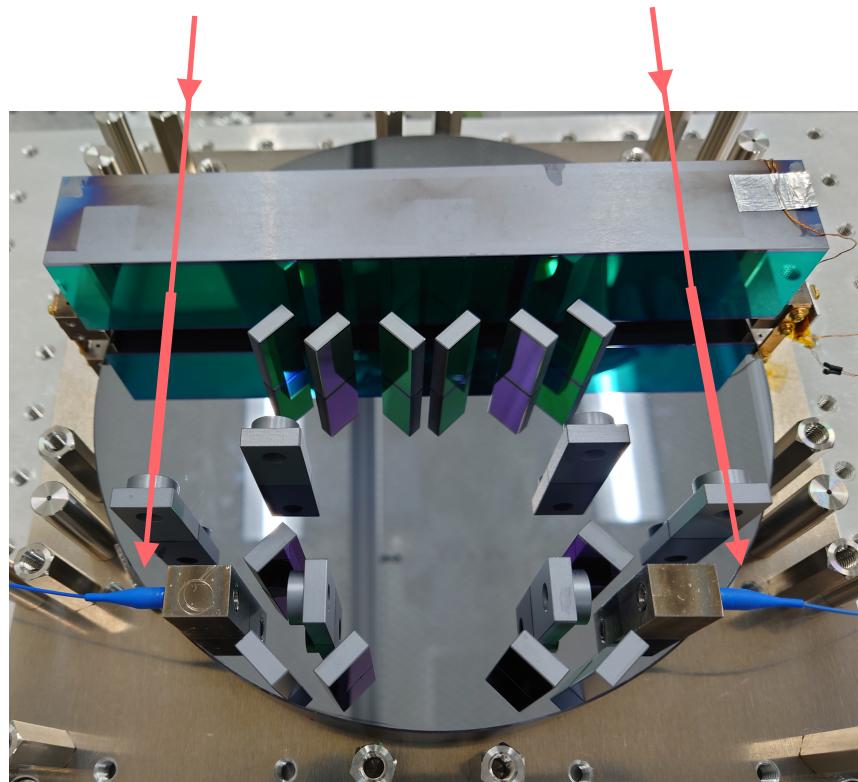
裏側のアラインメントは完了

ビームの高さの測定

- ▶ 共振軸の傾き・並進
- ▶ ミラーの傾き

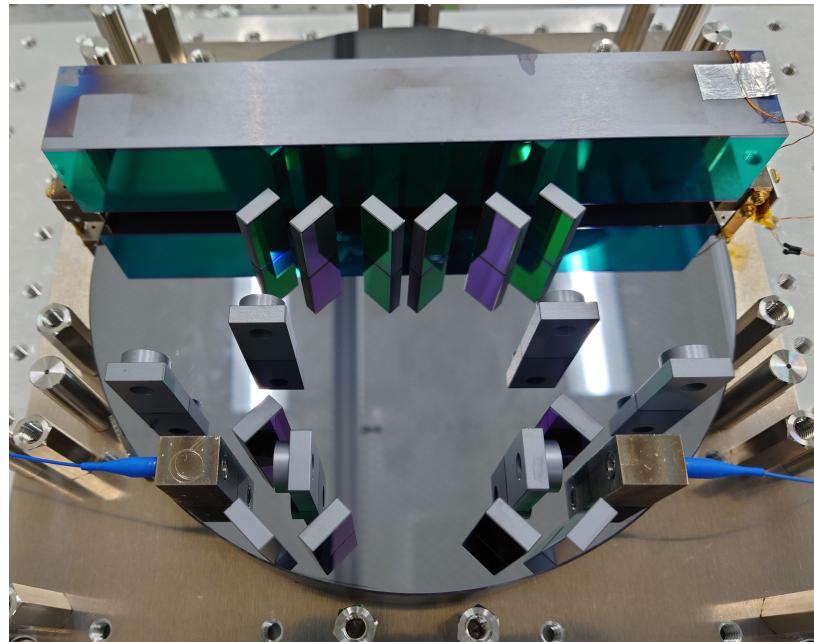
試験マスの姿勢を評価する

- ▶ ヒンジの取り付けで傾きを補正



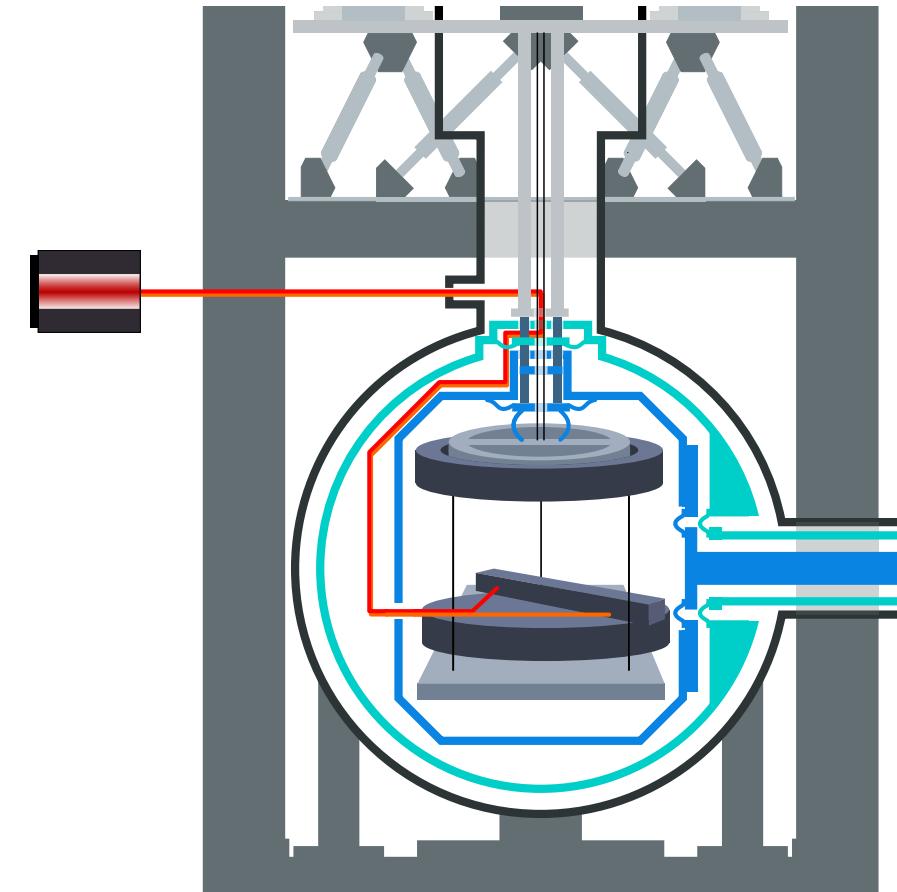
# まとめ

- ・ 低周波重力勾配測定に向けてPhase-III TOBAの開発
- ・ 高感度化に向けた低温モノリシック干渉計の開発
- ・ モノリシック光学系の構築
  - テンプレートを用いた位置決め
  - ステージを用いたアラインメント
  - ▶ レンズホルダーの口径でクリップ



# 今後の展望

- ・アライメントの改善
  - 裏側から光を入射して共振器軸の確認
  - 試験マスの姿勢の調整
- ・残りの光学系の接着
  - 入射光モニター (PD・QPD)
  - 透過光モニター (PD・QPD)
- ・低温試験
  - 真空槽にインストール
  - 4 Kに冷却
  - 感度  $10^{-16} \text{ rad}/\sqrt{\text{Hz}}$  を目指す

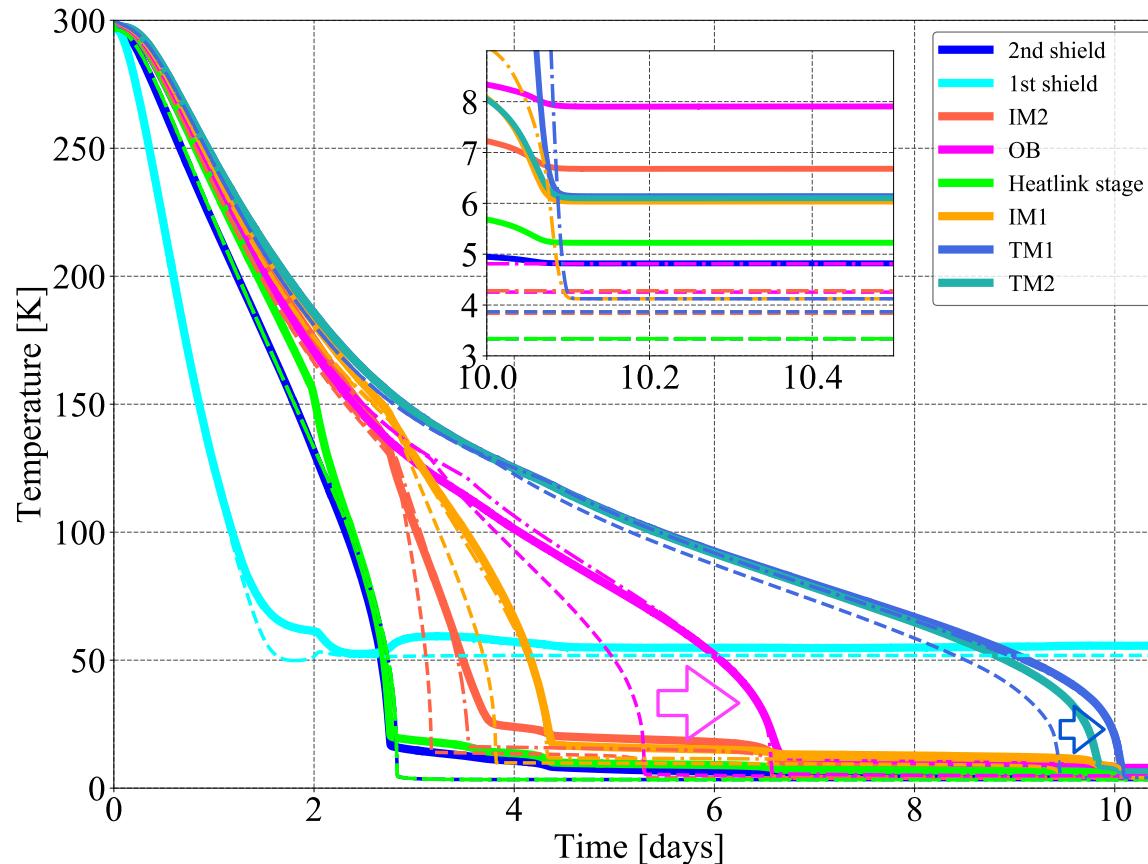




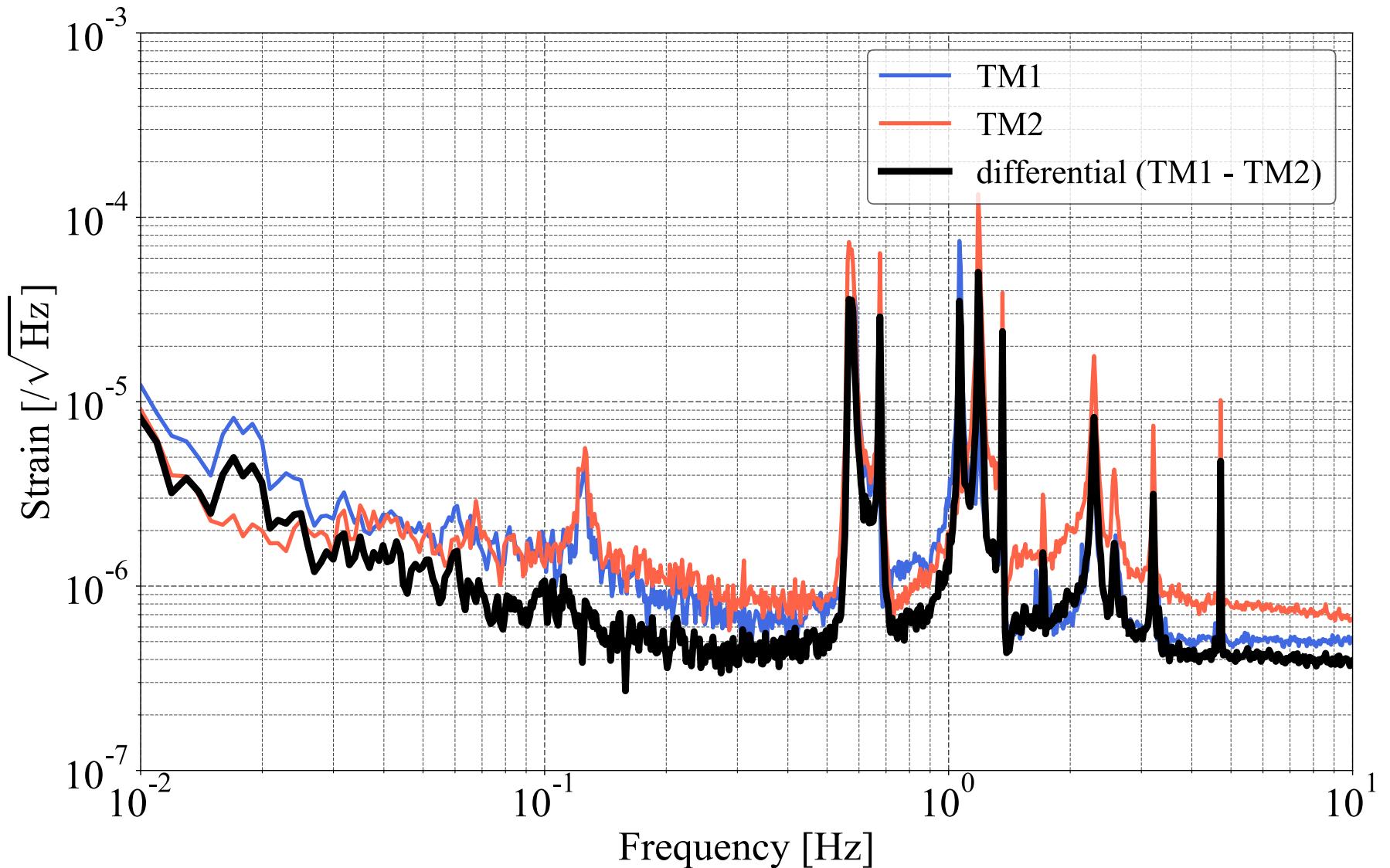


# 冷却結果

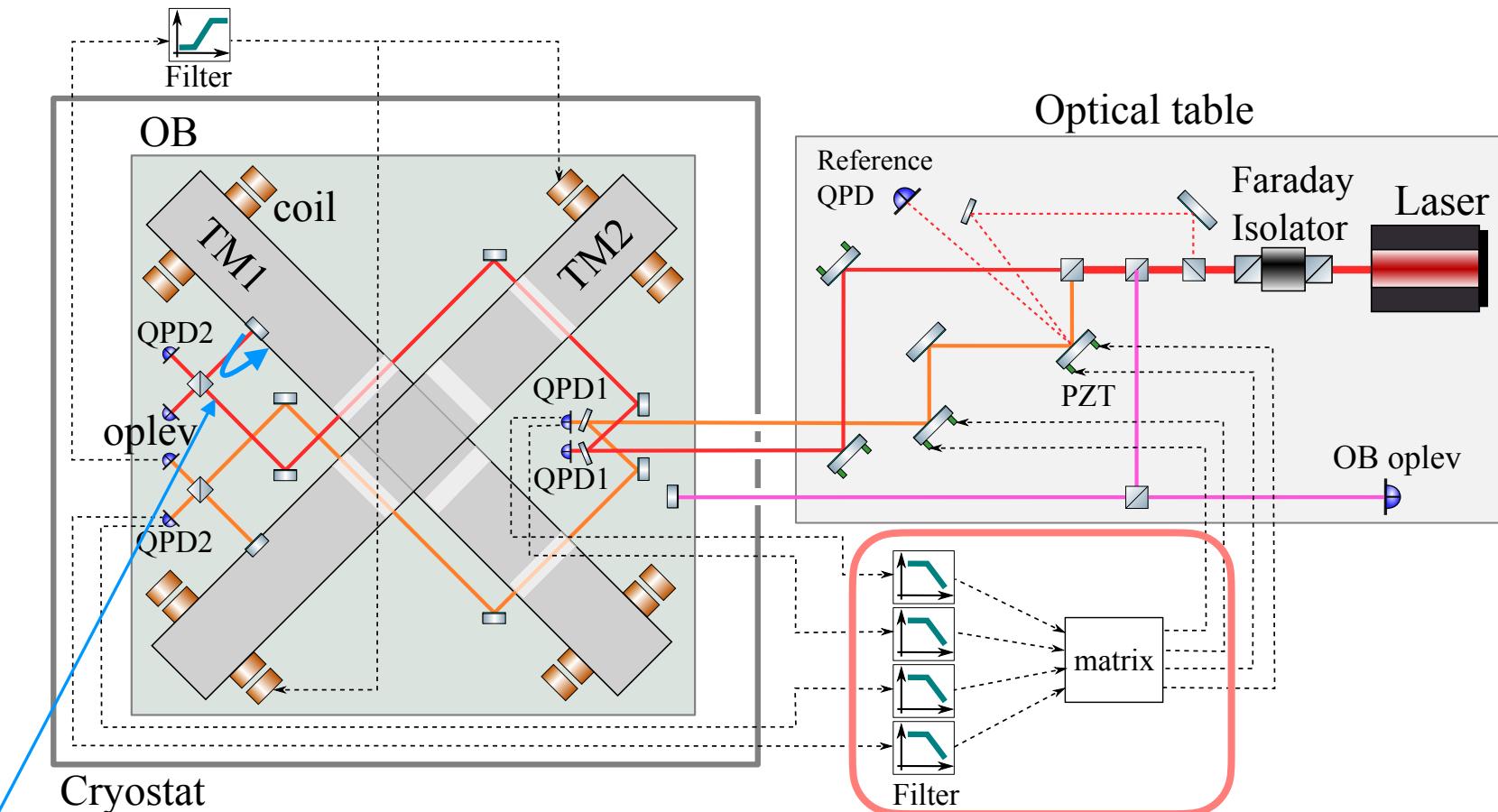
- 6.1 Kまでの冷却に成功 (4 Kの場合より1.2倍の熱雑音)
- 理論よりも冷却速度が遅い
  - ▶ ヒートリンクの熱接触が想定よりも悪い



# 現在の感度



# ビームジッター, 迷光



迷光雑音 :

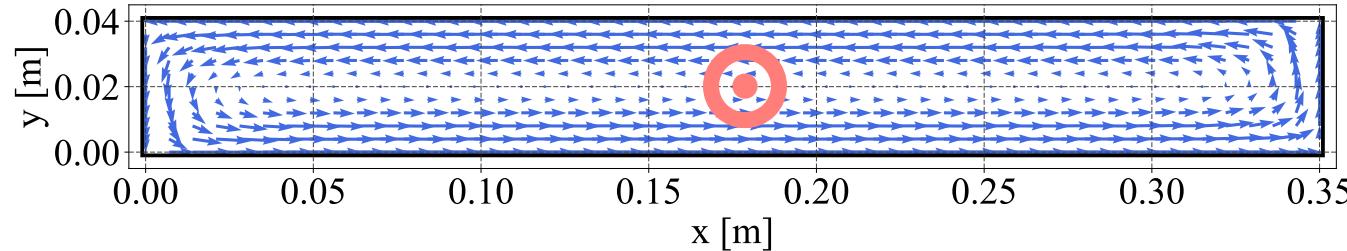
BSの表面反射などによる迷光が計測信号と干渉し, 強度変動を起こす雑音

ビームジッター制御雑音 :

ビームジッターの制御信号に強度変動などの信号が混入し, 制御を介して逆にビームを揺らしてしまう

# 磁場雑音

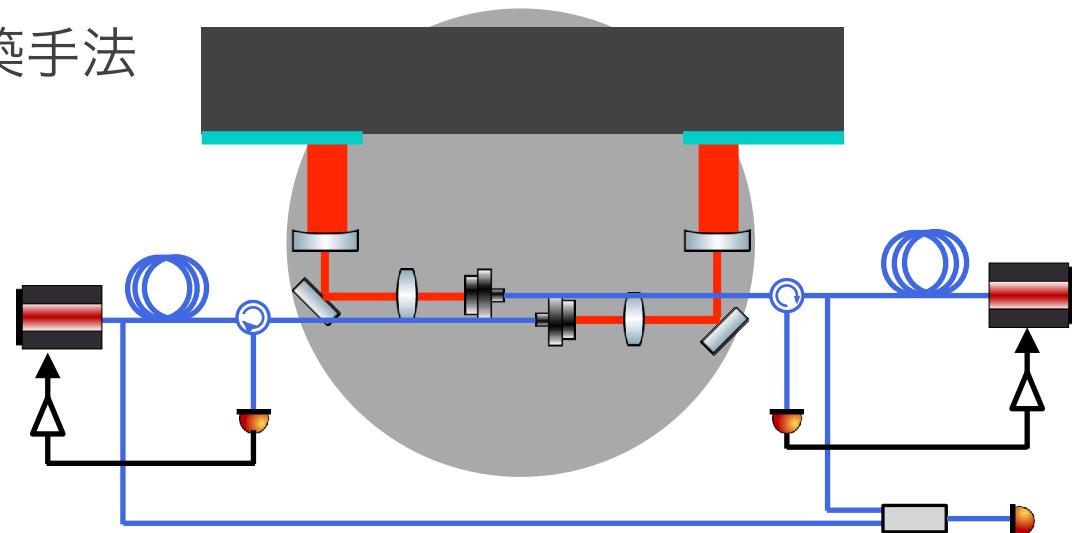
- 環境磁場変動による誘導電流が試験マスに流れ、磁気モーメント $\mu$ をもつ
- 環境磁場のDC成分Bとカップルし、トルク雑音 $N=B\times\mu$ が生じる



- $\mu$ は電気伝導度に比例
  - 低温になるほど寄与が大きくなる
- 現状  $10^{-9} / \sqrt{\text{Hz}}$  @ 0.1 Hz
  - 目標感度  $10^{-15} / \sqrt{\text{Hz}}$  達成には6桁の低減が必要

# 開発項目

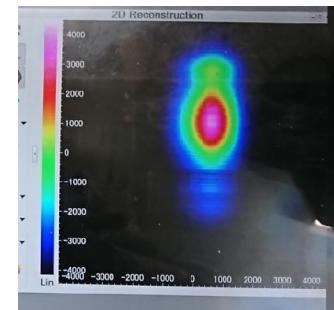
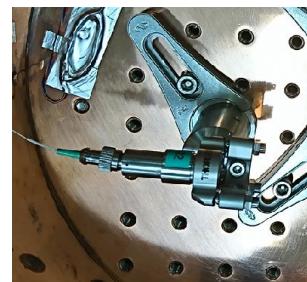
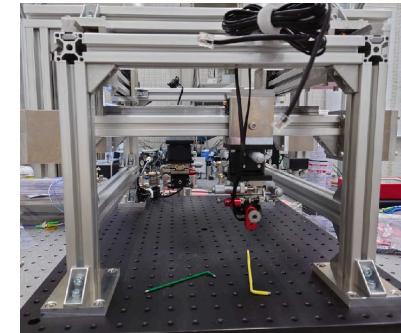
- ・モノリシック光学系の構築手法
  - 接着方法
  - アラインメント方法
- ・低温における動作
  - コリメーター
  - アラインメントずれ
  - PDの動作（透過光, 強度モニター用, etc.）
- ・光学系の雑音レベルの測定
  - 測定系（レーザー, 電気回路, …）



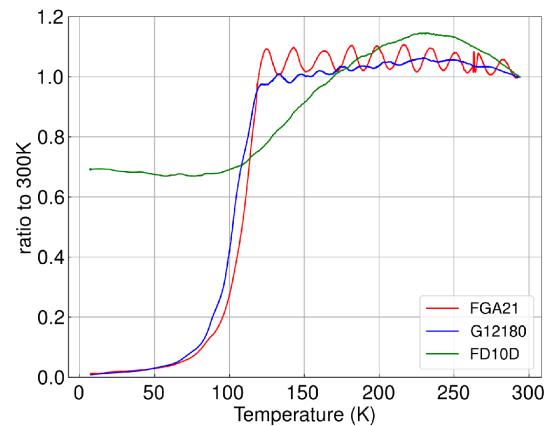
目標感度： $10^{-16} \text{ rad}/\sqrt{\text{Hz}}$

# 開発項目

- ・モノリシック光学系の構築手法
  - 接着方法 → エポキシ系接着剤
  - アラインメント方法
- ・低温における動作
  - コリメーター → 動作確認
  - アラインメントずれ
  - PDの動作（透過光, 強度モニター用, etc.）→ 動作確認
- ・光学系の雑音レベルの測定
  - 測定系（レーザー, 電気回路, …）



光学系構築の目処はおおむね立っている  
▶ 測定系の特性評価



# 低温試験

シリコン同士を

- Stycast 1266
- DP190

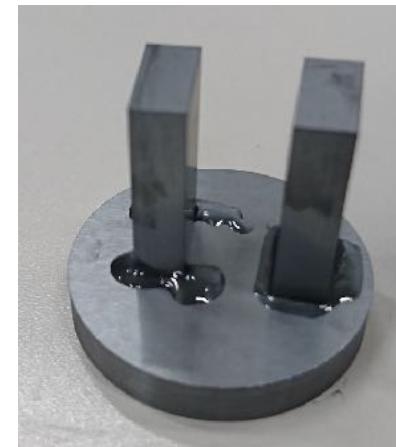
エポキシ



- NOA63
- NOA81

紫外線硬化樹脂

冷却 &  
昇温後



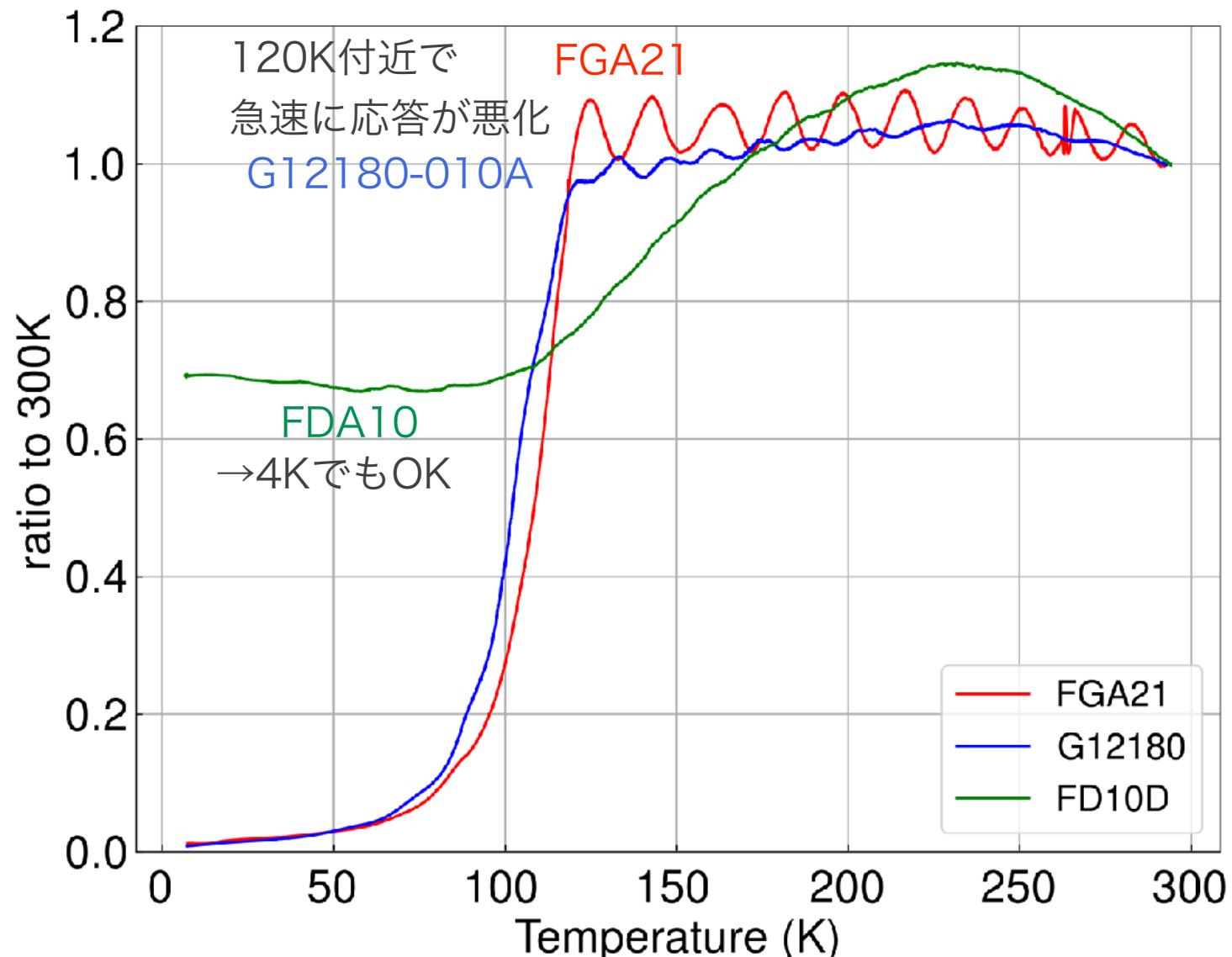
で接着し、4Kまで冷却

- ▶ 紫外線硬化樹脂は昇温後に剥離
- ▶ エポキシは昇温後も問題なし

**エポキシでの接着を採用**



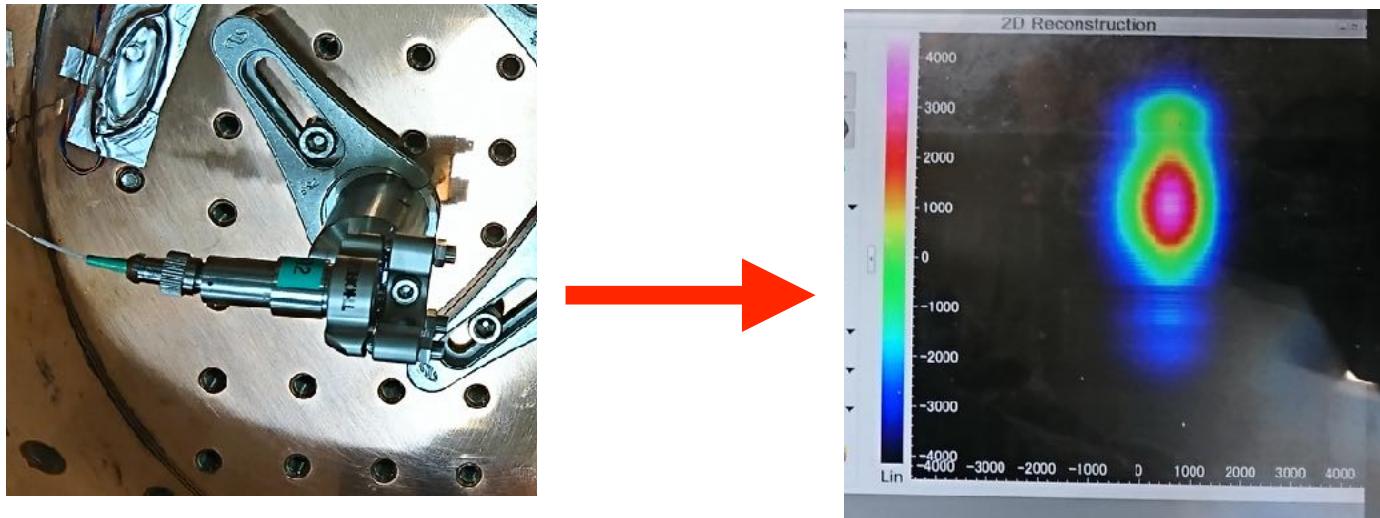
# フォトダイオード



# コリメーター

焦点固定コリメーター (F260APC-1550, Thorlabs) を使用

- 何度か冷却&昇温を繰り返していると出射ビームの形が変化



- 他の種類のコリメーターでも同様の現象
  - 低温化でレンズの位置が変化した可能性

現在はピグテールコリメーターを使用

- 今のところビームの形に異常はない

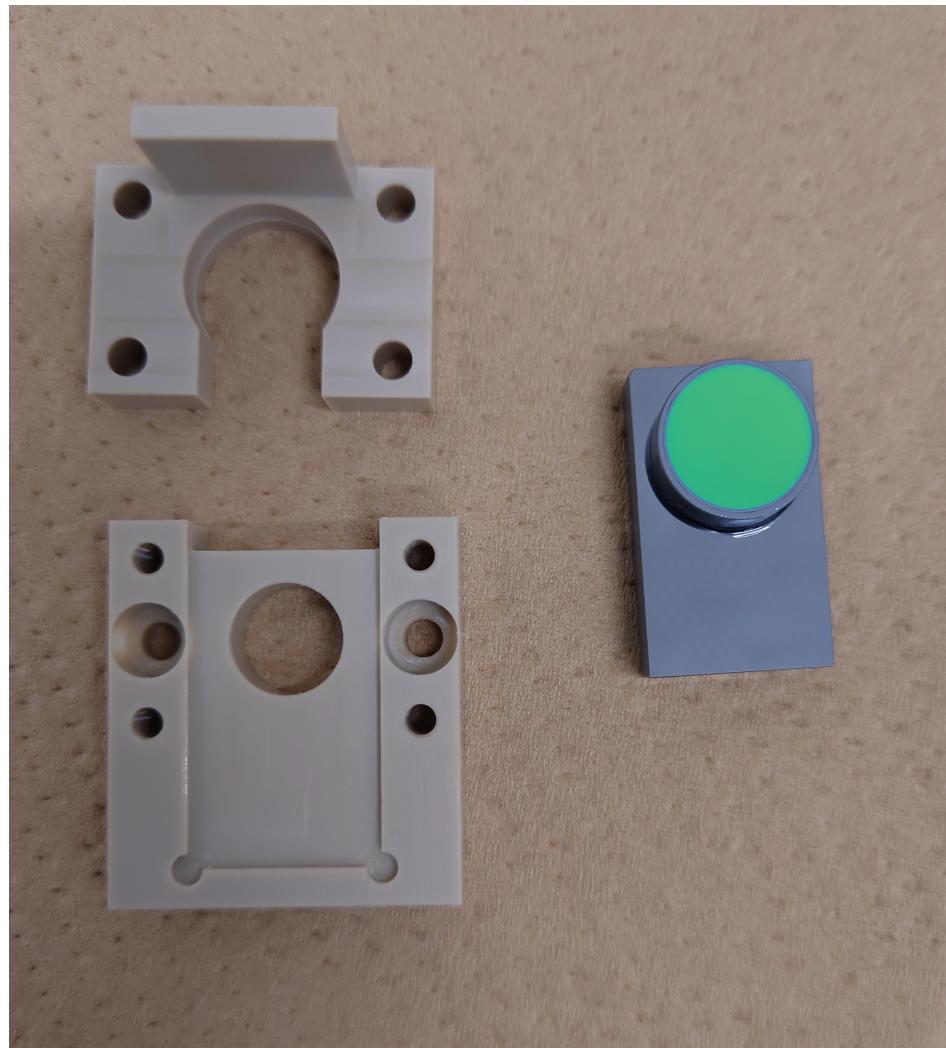
# 干渉計構成

	Michelson 干渉計	差動 Fabry-Perot	Fabry-Perot Michelson	改良型WFS
感度				?
周波数雑音				?
ビーム ジッター				?
並進 カップル				?
制御 自由度	1 (ねじれ回転)	2 (ねじれ回転, 並進運動)	3 (ねじれ回転, 並進運動, Michelson)	2 (ねじれ回転, 並進運動)

改良型WFSがベストだが不確定要素が多い → 差動FPを採用

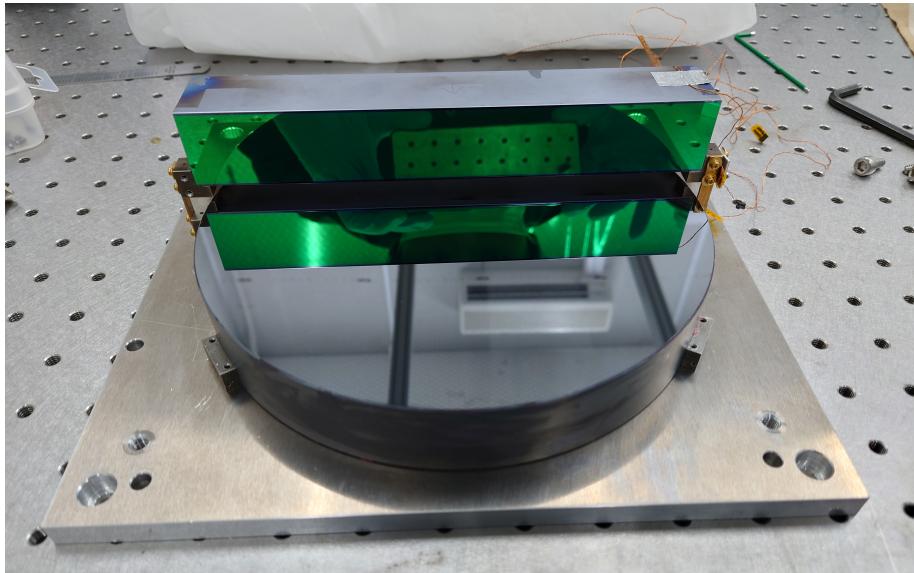
# Extra Photos

- Lens & cavity mirror bonding

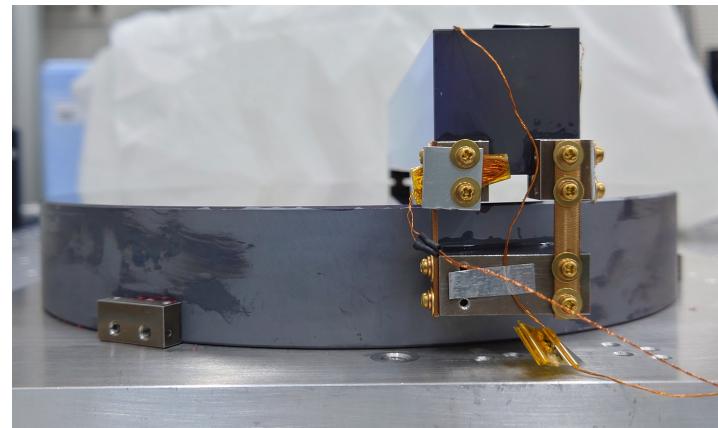
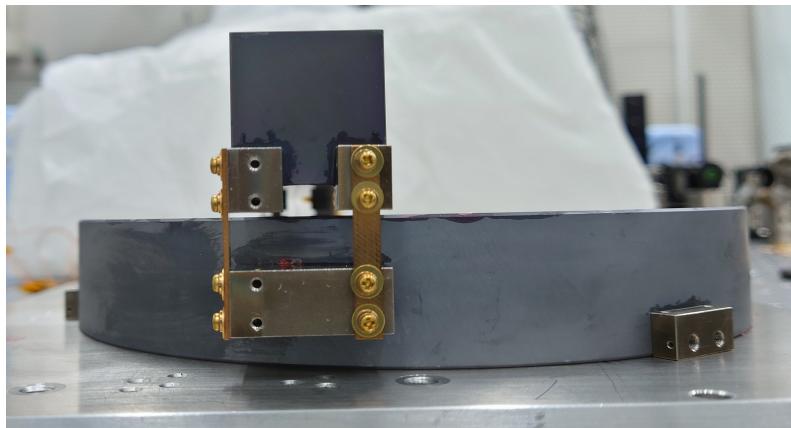
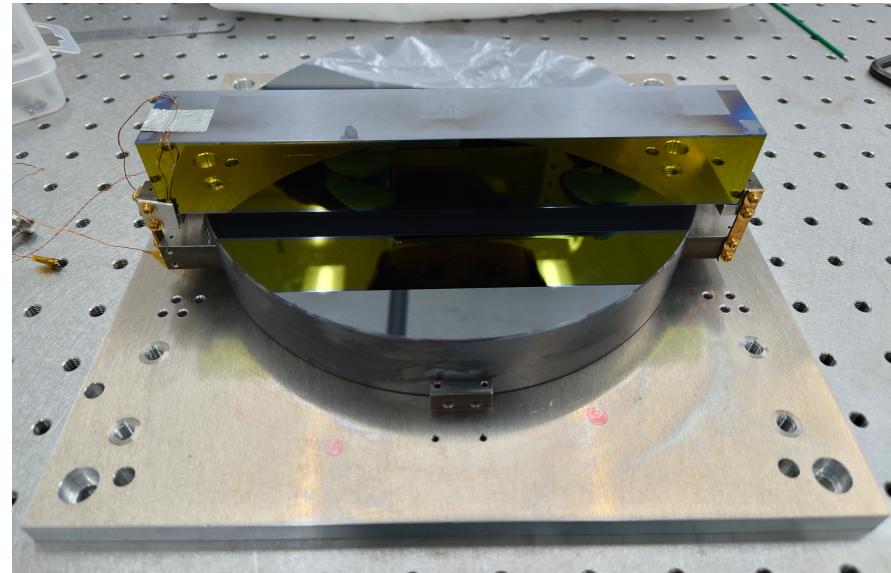


# TM Support

HR side

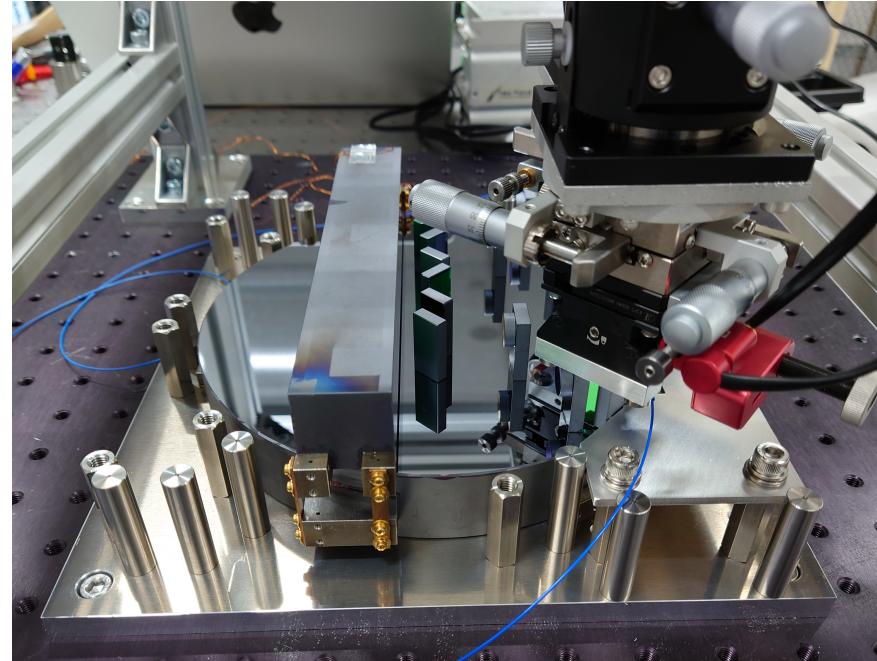
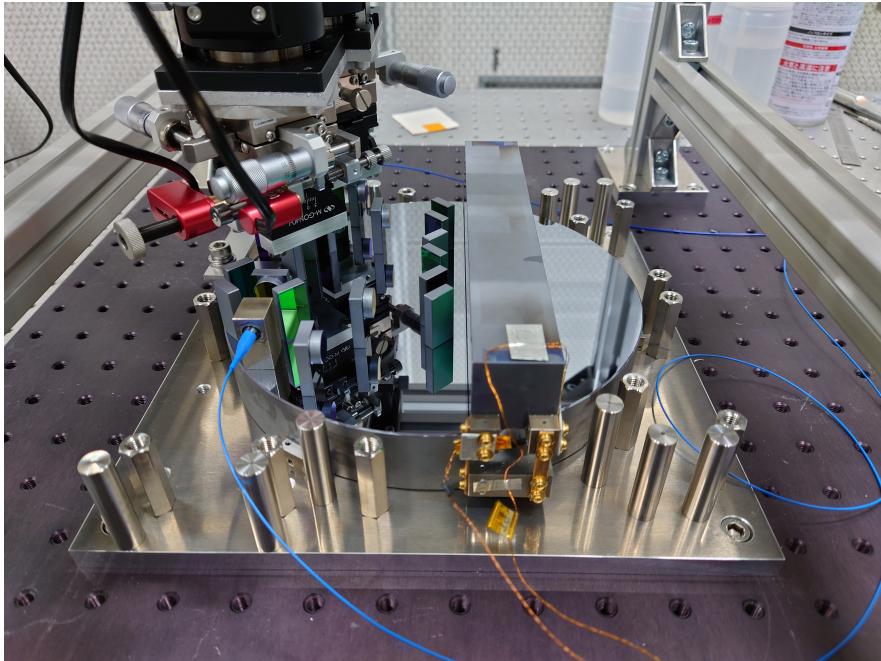


AR side



# 入射光学系のアライメント

微調整ステージを用いて入射光のアライメントを合わせる



- ▶ 途中でビームがクリップして完全には合わせられていない  
(モードマッチ率 60%程度が限界)
- ▶ 試験マスの姿勢調整が必要

# Collimator Bonding

